

高純度ガス 製品自動分析システム

Excellent, Ultimate, Fine, Clean & Safe Technology.

高純度ガスの『サンプリング』から『気密試験』『パージ』までを自動制御

成分分析に最適なガス環境をつくり、分析業務の効率化を実現します。

マスフローコントローラや
バルブなどを集積化
INTEGRATED GAS SYSTEM

タッチパネル式
自動制御システム
VALVE SIMULATOR



高純度ガス 製品自動分析システム

INTEGRATED GAS SYSTEM

集積化ガスシステム

半導体製造装置に使われている流体制御技術。バルブなどをコンパクトに接続でき、デッドボリュームを大幅削減。これにより内部の滞留部を減らすことができます。

流路の内面処理

配管の内面はフジキン独自の「UP処理」を採用。表面粗さをサブミクロンオーダーに維持しています。EP処理より滑らかな表面粗さを実現。ガス成分の吸着を抑えます。

ガス置換特性

「集積化ガスシステム」「流路の内面処理」によりガス置換性が大幅向上。腐食性・反応性ガスの吸着や反応を抑え、高純度のまま分析機器へ供給できます。

VALVE SIMULATOR

工程の自動化

「バルブシミュレータ」でポンベ接続部やサンプリング配管の気密試験・サイクルパージを自動化。タッチパネルで操作ができます。

高精度な流量・圧力制御

MFCなどを搭載し、自動で高精度な流体制御を行います。

複数のガスボンベを連続分析

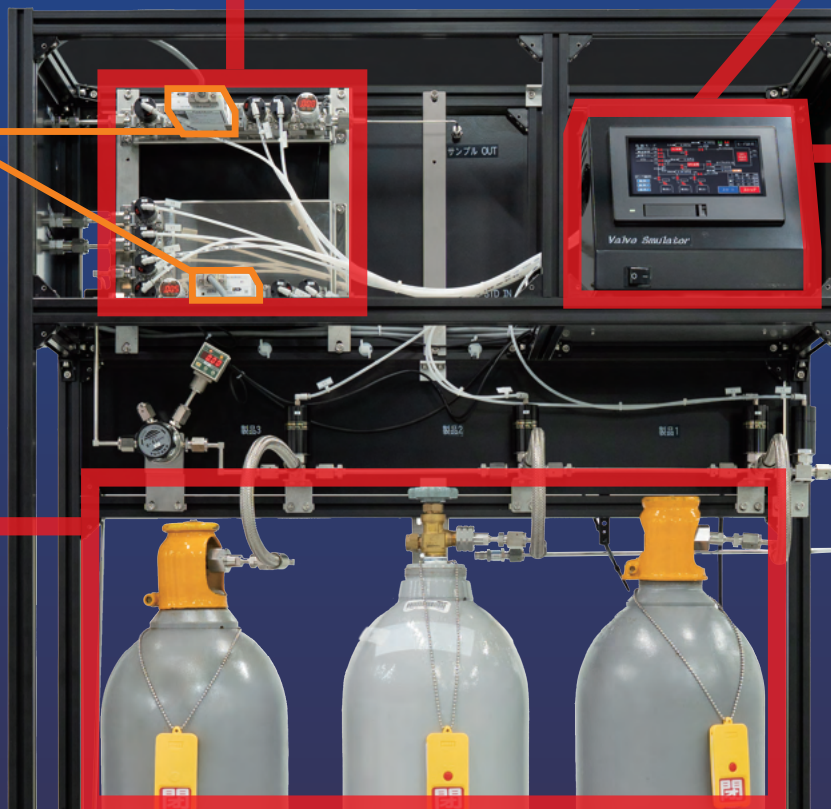
最大3本※のガスボンベから自動でガスをサンプリングし、分析計に供給できます。
※増設により接続本数を追加できます。

パソコンで遠隔操作

「バルブシミュレータ」とパソコンを接続させることで、遠隔操作ができます。

サイクルパージ技術

サイクルパージで不要ガスを確実に除去。ガス切替時の置換時間を大幅短縮し、製品分析の総時間を削減します。



■ フロー図

